

SPI

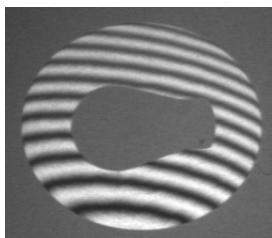
Interferometer für die Ebenheitsmessung von geläppten und feingeschliffenen Oberflächen



SPI Sichtprüfinterferometer ermöglichen die Prüfung der Ebenheit geläppter oder feingeschliffener Oberflächen, die mit dem Planglas keine Interferenzen zeigen. Neben den Standardversionen, weist die Sonderversion SPI xs eine erhöhte Empfindlichkeit auf. Das SPI nutzt das Prinzip des schrägen Lichteinfalls und zeigt damit Lichtbänder mit hohem

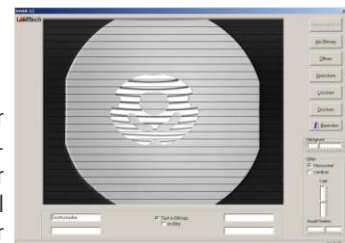
Kontrast, sowohl bei raueren als auch bei polierten Oberflächen. Die Teile werden zur Prüfung einfach auf eine Glasfläche an der Oberseite des SPI gelegt. Teil und Lichtbänder werden vergrößert auf einem Monitor dargestellt. Die Beurteilung der Lichtbänder ist gleich wie der Prüfung mit dem Planglas: gerade, parallele und

äquidistante Lichtbänder zeigen eine hohe Ebenheit an. Die SPI Sichtprüfinterferometer eignen sich zur Aufstellung in der Fertigung, direkt neben der Bearbeitungsmaschine. Mit dem optionalen Intdok Programm oder einem Videoprinter ist eine Dokumentation der Ebenheit möglich.



Interferogram einer Al_2O_3 - Regelscheibe, die als Bitmap im Intdok abgespeichert werden kann

Auszug aus der Auswertesoftware Intdok - Darstellung einer Regelscheibe mit horizontal einblendbarem Gitter



Spezifikationen

	SPI 75	SPI 130	SPI xs
Messfeld (Durchmesser)	75 mm	130 mm	65 mm (andere Größen auf Anfrage)
Ebenheit der Referenzfläche	besser $0,15 \mu\text{m}$ (bei konstanten Umgebungsbedingungen)		
Größe (L x B x H)	340 mm x 200 mm x 240 mm	550 mm x 280 mm x 350 mm	340 mm x 200 mm x 240 mm
Gewicht	9 kg	26 kg	9 kg